

From Eye to Insight

Leica



Leica EM TXP 精研一体机

一款专门的可对目标区域进行精确定位的表面处理工具，特别适合于SEM，TEM及LM观察之前对样品进行定点切割、研磨、抛光等系列处理。

特点：

- ◆ 五合一：铣削、切割、研磨/抛光、冲钻、原位显微观察
- ◆ 对微小目标区域进行精准定位和样品制备
- ◆ 通过立体显微镜实现实时原位观察
- ◆ 自动化样品处理过程控制
- ◆ 可获得平如镜面的抛光效果



微尺度制样利器！



立刻拨打 400-650-6632
www.leica-microsystems.com.cn